

研究テーマ名	UBMS法による極印の表面処理に関する研究
研究内容抄録	<p>UBMS (Unbalanced Magnetron Sputtering) 法を用いた極印表面処理装置を導入し、装置の習熟を含めて各種テストを実施した。</p> <p>クロムメッキが施されている一部の勲章用極印への成膜試験やメッキ極印上への成膜試験等DLC (Diamond-like carbon) 膜の用途拡大に関する調査を行うとともに、記念貨幣用の極印にDLCを成膜して圧印試験を行い、命数の向上を確認するとともに、微細加工を施したプルーフ品質のメダルの極印にDLCを成膜して圧印し、品質を確認した。</p>
学会発表	—